

INSD NanoScience Seminar (No.21)

日時：平成 29 年 7 月 26 日(水) 午後 4 時 50 分～6 時 20 分

場所：豊中キャンパス、文理融合型研究棟 3 階 305 号室
ナノサイエンスデザイン教育研究センターセミナー室

講演題目：収差補正電子顕微鏡による
原子レベルでの材料解析

講演者：渡辺 万三志 氏
Materials Science and Engineering,
Lehigh University, USA



講演は日本語で行われます

講演概要：

収差補正電子顕微鏡や超高速検出器など，近年のハードウェアの充実は目を見張るものがある．こういった最新鋭の電子顕微鏡技術を利用すれば，原子分解能での組織観察だけでなく，X線や電子線損失などの分光法を併用した総括的な材料解析が可能となりつつある．本講演では，収差補正電子顕微鏡を用いた原子レベルでの材料解析の必要性を実例を交えて紹介するとともに，原子レベルでの解析における問題点，特にX線分光法における定量性について理論を併用し，その可能性を議論する．

連絡先：ナノサイエンスデザイン教育研究センター 伊藤正
E-mail: itoh@insd.osaka-u.ac.jp